

## عنوان مقاله:

اندازه‌گیری جابجایی میکروعملگرها شکل الکتروترمال با استفاده از میکروویسوسنسور

## محل انتشار:

سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

## نویسندگان:

حمید سلمانی نهوجی - دانشگاه تهران

محسن حامدی

محمد صالحی

حامد مجیدی فردوطن

## خلاصه مقاله:

سیستم های میکروالکترومکانیکی یا ممز ترکیبی از اجزای مکانیکی سنسورها عملگرها و قطعات الکترونیکی بر روی یک لایه سیلیکون به کمک فناوری ساخت تراشه های میکرونی می باشد از جمله ادوات ممز میتوان به میکروگریپرها میکروموقعیت دهندها میکروکلمپ ها میکروسنسورها و ... اشاره نمود که میکروگریپرها در جابجایی و موقعیت دهی قطعات با مقیاس کوچک کاربرد بسیاری دارند میکروگریپر برای گیره بندی نیاز به تحریک دارد عملگرهای الکتروترمال با توجه به نحوه عملکرد و سادگی استفاده دارای کاربرد زیادی نسبت به عملگرهای الکترواستاتیک پیزوالکتریک آلیاژ حافظه دار و ... دارند عملگرهای برقی - حرارتی که با استفاده از میکروماشین کاری سطحی ساخته می شوند از خاصیت انبساط طولی برای حرکت سازه استفاده می کنند انبساط طولی ناشی از پدیده گرمایش ژول است که به دلیل عبور جریان از بازوهای عملگر ایجاد می شود.

## کلمات کلیدی:

عملگرمیکروالکتروترمال، پیزوسنسور

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/176699>

